Механизмы возникновения и релаксации самопроизвольной поляризации в тонких сегнетоэлектрических пленках

© В.П. Афанасьев, И.П. Пронин*, А.Л. Холкин**

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", 197376 Санкт-Петербург, Россия * Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия ** Университет Авейро, Авейро, Португалия

E-mail: petrovich@mail.ioffe.ru

Обсуждается природа и механизмы возникновения самопроизвольной поляризации в тонких сегнетоэлектрических пленках в процессе формирования тонкопленочной конденсаторной структуры и ее релаксации под воздействием электрического поля, температуры и освещения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 04-02-16738) и Федерального агенства по образованию РФ (проект № 75112).

PACS: 77.22.Ej, 77.84.Dy

Природа самопроизвольной макроскопической поляризации (самополяризации), которая наблюдается в ряде случаев в тонких сегнетоэлектрических пленках, до сих пор вызывает споры, и для ее объяснения предлагаются различные механизмы, связанные с действием как электрических полей, так и механических сил. Наиболее подробно эффект исследован в тонкопленочных конденсаторных структурах с сегнетоэлектрическими слоями на основе титаната свинца PbTiO₃ (PZT, PLZT и PLT), а также титаната бария BaTiO₃.

Степень самопроизвольной поляризованности тонких пленок зависит от множества факторов, среди которых наиболее значимыми являются степень текстурированности поликристаллических пленок [1], температура формирования перовскитовой фазы [2], концентрация дефектов и вводимых в пленку примесей [3], материал подложки [4,5], различные материалы нижнего и верхнего электродов [6]. Самополяризация меняет ориентацию по мере добавления в распыляемую мишень оксида свинца [7], уменьшается с ростом толщины [8] и соотношения Zr/Ti в пленках PZT [8,9]. Высокотемпературный отжиг (выше температуры Кюри) может приводить к полному исчезновению самополяризованного состояния [8,10,11], однако, согласно [12], в пленках титаната бария отжиг не приводит к исчезновению самополяризации.

Для объяснения эффекта привлекаются представления о поляризующем воздействии объемного заряда, локализованного на нижнем интерфейсе тонкой пленки [8,13,14], поляризующем действии электрического поля барьера Шоттки, высота которого при использовании электродов из разных материалов может существенно различаться на нижнем и верхнем интерфейсах пленки [8]. Другие объяснения основаны на предположении образования неоднородного по толщине пленки объемного заряда или упорядоченного расположения дипольных моментов примесей в кристаллической решетке [15]. Действие линейных сжимающих (растягивающих) сил на сегнетоэлектрическую пленку также может усилить (или ослабить) эффект самополяризации [5,16]. В последнее время возможной причиной самополяризации называют флексоэлектрический механизм, возникающий из-за различных коэффициентов расширения пленки и подложки и приводящий к изгибной деформации подложки с нанесенной на нее многослойной структурой [17,18].

В настоящей работе на основе проведенных экспериментов и ранее опубликованных работ обсуждаются причины, приводящие к появлению и релаксации самополяризованного состояния в тонких пленках РZT.

Тонкие пленки РZT толщиной $0.5-1\,\mu$ m осаждались на подложки из ситалла и кремния ВЧ-магнетронным распылением при низкой температуре, а затем отжигались при 550°С [19]. Структурные исследования, проведенные ранее [19,20], показали, что пленки имели поликристаллическую структуру с характерным размером кристаллитов 100–200 nm и выраженной (111)-текстурой. В качестве электродов тонкопленочного сегнетоэлектрического конденсатора использовалась платина. Изучались пленки, распыленные из мишеней стехиометрического состава и мишеней, содержащих дополнительно 10% PbO или 3% Nb₂O₅.

Сравнительное исследование электрофизических свойств таких пленок показало следующее.

1) Пленки, полученные распылением мишеней стехиометрического состава, не проявляли свойств, характерных для самополяризованного состояния. Петли гистерезиса и C-V-характеристики имели симметричный вид. Термодеполяризационные токи, полученные на предварительно поляризованных образцах, при быстром нагреве образцов до температур, близких к температуре Кюри, соответствовали распаду макроскопического полярного состояния (рис. 1, *a*). Изучение локального пьезоотклика с использованием пьезоэлектрического атомно-силового микроскопа показало, что распределение пьезоотклика по площади пленки также имеет сим-



Рис. 1. Временная зависимость тока деполяризации при нагревании образца до 250°С для пленки, полученной распылением стехиометрической мишени $PbZr_{0.54}Ti_{0.46}O_3$ и поляризованной при +10V(a), и для пленки, полученной из мишени с 10% избытком PbO и поляризованной при +17V(b). Кривые *1* отображают процесс нагрева образцов во времени, а кривые 2 — ток.

метричный вид с максимумом распределения, соответствующим нулевому значению пьезоотклика (рис. 2, *a*).

2) В пленках нестехиометрического состава (с избытком PbO или Nb) петли гистерезиса (кривая I на рис. 3) и C-V-характеристики имели асимметричный вид и были сдвинуты в сторону отрицательных напряжений. Это свидетельствует о наличии внутреннего поля, создаваемого отрицательным зарядом на нижнем интерфейсе, и вызываемого им самополяризованного состояния, вектор которого ориентирован в сторону нижнего электрода (рис. 4, a). Такое поведение предполагает электронный тип проводимости в пленке РZT, возникающий за счет кислородных вакансий при введении в пленку избытка либо PbO, либо Nb. Распределение пьезоотклика по площади пленок, содержащих избыток оксида свинца, также асимметрично (рис. 2, b), что указывает на существование макроскопической поляризации, направленной к нижнему интерфейсу. Наряду с направлением тока, соответствующим распаду макроскопической поляризации, при высокой температуре протекал ток противоположного направления, обусловленный релаксацией отрицательного объемного заряда на нижнем интерфейсе (рис. 1, b) [21].

3) Повышение температуры подложки при осаждении пленок с 200 до 300°С из-за образования вакансий по свинцу и как следствие изменения типа проводимости с электронного на дырочный приводило к изменению направления внутреннего поля (кривая 2 на рис. 3). Таким образом, положительный заряд на ловушках нижнего интерфейса пленки РZT ориентировал вектор самополяризации в направлении верхнего электрода.



Рис. 2. Гистограммы пьезоотклика пленок, осажденных из стехиометрической мишени (*a*) и содержащих избыток PbO (*b*), до и после ультрафиолетового облучения.



Рис. 3. Петли гистерезиса пленок РZT, полученных распылением мишени $PbZr_{0.54}Ti_{0.46}O_3 + 3\% Nb_2O_5$ при температурах подложки 200 (1) и 300°C (2).

4) Ультрафиолетовое излучение понижало степень асимметрии распределения локального пьезоотклика (рис. 2, b) в пленках с избытком свинца. Причины такого изменения кроются в том, что излучение в основном поглощается в приповерхностном слое пленки и часть генерированных электронов захватывается на ловушки верхнего интерфейса и создает поле, поляризующее приповерхностный слой пленки (рис. 4, b). Приэлектродные области пленки оказываются поляризованными навстречу друг другу, что приводит к понижению самополяризации.

5) Зависимость самополяризации от соотношения x = Zr/(Ti + Zr), выявленная в пленках РZT в [9], также может быть объяснена действием электрического поля локализованных зарядов на интерфейсах (кривая 2 на рис. 5). Если предположить, что плотность ловушек на нижнем интерфейсе не зависит от состава пленок РZT, т. е. что локализованный заряд одинаков, то кривая 2 хорошо описывается в тетрагональной фазе зависимостью (кривая 3)

$$P(x)/P_{\max}(x) = [\varepsilon_{\text{th}}/\varepsilon(x)]^{1/2},$$

где $\varepsilon_{\rm th}$ — величина диэлектрической проницаемости, при которой самополяризация достигает насыщения $P_{\rm max}(x)$, $\varepsilon(x)$ — кривая I [9,16]. Монотонное убывание самополяризации в тетрагональной фазе РZT при приближении к морфотропной фазовой границе (МРВ) определяется величиной поляризующего электрического поля на нижнем интерфейсе E_0 , пропорционального $\varepsilon(x)^{-1/2}$ [16]. В ромбоэдрической фазе предлагаемая модель, казалось бы, не работает (кривые 2, 3 на рис. 5). Однако в [8] приводятся результаты исследования концентрационной зависимости в ромбоэдрической фазе, которые показали при x = 0.5 - 0.7 рост величины самополяризации по мере удаления от МРВ, что может являться подтверждением предложенной модели.

Таким образом, формирование самополяризованного состояния в исследуемых нами пленках определяется электрическими полями вблизи интерфейсов, величина которых зависит от плотности зарядов на ловушках нижнего и верхнего интерфейсов и диэлектрической проницаемости пленки PZT, а направление — знаком носителей заряда.

6) Наблюдаемое на MPB резкое падение (скачок) самополяризации может быть объяснено с учетом воздействия механических напряжений на пленку со стороны подложки. Анализ показал, что характер изменения самополяризации на MPB зависит от ориентации тек-



Рис. 4. Схематическая модель пленки РZT, отражающая исходное самополяризованное состояние (a), его изменение в результате ультрафиолетового освещения (b) и после отжига при температуре, близкой к температуре Кюри (c).



Рис. 5. Концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости [9] (1) и самополяризации в пленках РZT (2 — эксперимент [9], 3 — расчет).



Рис. 6. Расчетная диаграмма изменения самополяризованного состояния в области МРВ для $\langle 111 \rangle$ -ориентированных пленок РZT, сформированных на подложках кремния (*a*) и ситалла CT-50 (*b*).

стурированной пленки и действующих на нее растягивающих или сжимающих напряжений [16]. Диаграмма, представленная на рис. 6, a, находится в согласии с экспериментально наблюдаемым уменьшением самополяризации на МРВ в $\langle 111 \rangle$ -текстурированной пленке РZT (кривая 2 на рис. 5), что связано с действием на пленку растягивающих напряжений.

Иная ситуация может иметь место на МРВ при использовании ситалловой подложки, у которой величина температурного коэффициента линейного расширения больше, чем у кремния ($\alpha_{\rm Si} = 2.8 \cdot 10^{-6} \, {\rm cm}^{-1}$, $\alpha_{\rm CT} = 5 \cdot 10^{-6} \, {\rm cm}^{-1}$). Расчет показывает, что в этом

случае на пленку действуют сжимающие напряжения и величина самополяризации при переходе на ромбоэдрическую фазу должна возрасти (рис. 6, *b*).

Отмеченное подтверждают результаты излучения самополяризованного состояния пленок РZT, сформированных на подложках из ситалла и кремния [22].

Тем не менее в настоящее время роль механических напряжений (как линейных, так и нелинейных) в формировании самополяризованного состояния изучена недостаточно и требует проведения дальнейших исследований.

Список литературы

- M. Adachi, T. Matsuzaki, N. Yamada, T. Shiosaki, A. Kawabata. Jpn. J. Appl. Phys. 26, 4, 550 (1987).
- [2] H. Maiwa, N. Ishinose, K. Okazaki. Jpn. J. Appl. Phys. 33, Pt I, 9B, 5240 (1994).
- [3] R.D. Klissurska, A.K. Tagantsev, K.G. Brooks, N. Setter. Microelectron. Eng. 29, 271 (1995).
- [4] K. Iijima, R. Takayama, Y. Tomita, I. Ueda. J. Appl. Phys. 60, 2914 (1986).
- [5] T. Ogawa, A. Senda, T. Kasanami. Jpn. J. Appl. Phys. 30, 9B, 2145 (1991).
- [6] R. Jimenez, C. Alemany, J. Mendiola. Ferroelectrics 268, 131 (2002).
- [7] M. Kobune, H. Ishito, A. Mineshige, S. Fujii, R. Takayama, A. Tomozawa. Jpn. J. Appl. Phys. **37**, Pt I, *9B*, 5154 (1998).
- [8] A.L. Kholkin K.G. Brooks, D.V. Taylor, S. Hiboux, N. Setter. Integr. Ferroelectrics 22, 525 (1998).
- [9] R. Bruchhaus, D. Pitzer, M. Schreiter, W. Wersing. J. Electroceram. 3, 2, 151 (1999).
- [10] E.G. Lee, J.S. Park, J.K. Lee, J.G. Lee. Thin Solid Films 310, 327 (1997).
- [11] И.П. Пронин, Е.Ю. Каптелов, Е.А. Тараканов, В.П. Афанасьев. ФТТ 44, 9, 1659 (2002).
- [12] K. Abe, S. Komatsu, N. Yanase, K. Sano, T. Kamakubo. Jpn. J. Appl. Phys. 36, Pt I, 9B, 5846 (1997).
- [13] J. Frey, F. Schlenkrich, A. Schonecker. Integr. Ferroelectrics 35, 195 (2001).
- [14] V.P. Afanasjev, A.A. Petrov, I.P. Pronin, E.A. Tarakanov, E.Ju. Kaptelov, J. Graul. J. Phys. D: Cond. Matter 13, 8755 (2001).
- [15] D. Dimos, W.L. Warren, M.B. Sinclair, B.A. Tuttle, R.W. Schwartz. J. Appl. Phys. 76, 7, 4305 (1994).
- [16] И.В. Пронин, Е.Ю. Каптелов, А.В. Гольцев, В.П. Афанасьев. ФТТ 45, 9, 1685 (2003).
- [17] E. Sviridov, I. Sem, V. Alyoshin, S. Biryukov, V. Dudkevich. Vater. Res. Soc. Symp. Proc. 361, 141 (1995).
- [18] A. Gruverman, B.J. Rodriguez, A.I. Kingon, R.J. Nemanich, A.K. Tagantsev, J.S. Cross, M. Tsukada. Appl. Phys. Lett. 83, 728 (2003).
- [19] В.П. Афанасьев, Г.Н. Мосина, А.А. Петров, И.П. Пронин, Л.М. Сорокин, Е.А. Тараканов. Письма в ЖТФ 27, 11, 56 (2001).
- [20] V.V. Shvartsman, A.V. Pankrashkin, V.P. Afanasjev, E.Yu. Kaptelov, I.P. Pronin, A.L. Kholkin. Integr. Ferroelectrics 69, 103 (2005).
- [21] И.П. Пронин, Е.Ю. Каптелов, Е.А. Тараканов, Т.А. Шаплыгина, В.П. Афанасьев. ФТТ 44, 4, 739 (2002).
- [22] А.А. Богомолов, О.Н. Сергеева, Д.А. Киселева, Е.Ю. Каптелов, И.П. Пронин. Письма в ЖТФ 31, 11, 42 (2005).